



- 超高温性能**
高达1750°C的双炉体
- 最高准确度的悬挂式对称天平**
消除漂移和浮力影响，优化气体与样品的相互作用
- 模块化设计**
高达1750°C的: TGA, DTA, TG-DTA
高达1600°C的: DSC, TG-DSC
- 超高的准确性和灵敏度**
三对热电偶DTA及DSC技术
- 多种气氛条件**
多种载气和反应气体可选
- 外部联用能力**
可以和各类仪器联用，如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

基本参数		TGA	DTA, TG-DTA	STA DSC, TG-DSC
温度范围(°C)		室温 ~ 1750	室温 ~ 1750	室温 ~ 1600
程控温度扫描速率(°C/min)		0.01 ~ 100		
坩埚容积和最大样品尺寸		55 ~ 1500 µl 或 高度: 20 直径: 14 mm, 不含坩埚	20 ~ 300 µl	75 ~ 110 µl
气路	单一气体选项	3路载气, 可选其中1路进气, 1MFC		
	混合气体选项	3路载气, 可选其中1路进气 + 1路辅助气, 2 MFC		
	腐蚀性气体选项	带1个质量流量计MFC的1路载气(3个接口)及 1路不带质量流量计控制的腐蚀性气体管路		
真空		初级真空(< 5*10 ⁻² mbar), 二级真空可选		
重量(kg)		145		
尺寸(H/W/D)		170 / 60 / 55 cm		
天平				
量程(mg)	小	+/- 20		
	大	+/- 200		
最大样品量(g)		35		
热重基线漂移(温度扫描) ^{b,c}		5 µg 最高1700 °C		
热重基线漂移精度(µg) ^c		+/- 1		
天平分辨率(µg)		0.002		
DTA/DSC		DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC	
量热精度 ^{c,e}		+/- 2 % ^f	+/- 1 %	
温度精度 ^{c,e}		+/- 0.8 °C	+/- 0.4 °C	
温度准确度 ^{c,e}		+/- 0.4 °C	+/- 0.25 °C	

b. 在氮气环境下 c. 标准数据 e. 基于金属标准样品熔融 f. 技术规格在校准后可能会发生变化

THEMYS DUO的悬挂式等臂天平可连续测量样品和惰性参比材料之间的质量差异，两者放置在温度与气氛条件几乎相同的两个独立加热炉中。

几乎完全消除零漂移或浮力效应，是进行长期稳定性研究的最佳选择。

系统的悬挂原理优化了气体与样品间的相互作用，使样品最大限度地接触环境气氛。

多种气体控制选项:

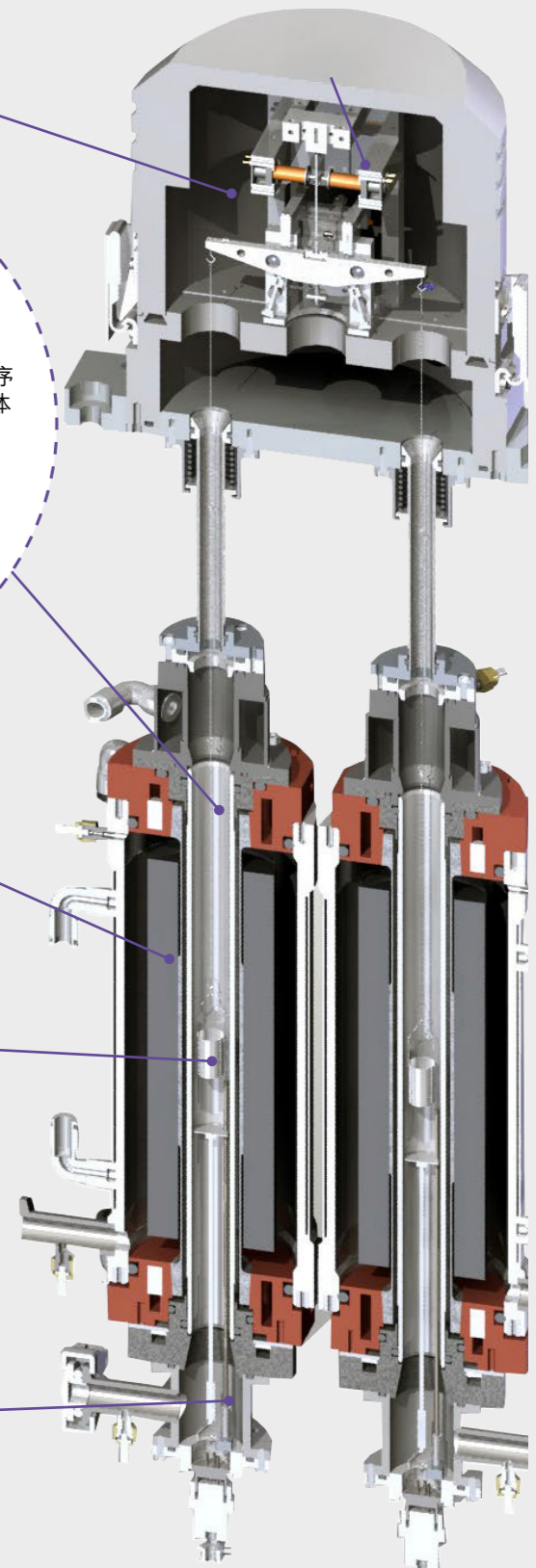
- 配有智能软件的气路控制系统，可按程序来控制样品预处理或测试过程中切换气体种类，控制流量，改变气体混合比例；
- 真空操作及预处理选项；
- 腐蚀性气氛测试套件可在保护仪器的同时，测试样品的反应活性。

THEMYS DUO双炉体由相同的两个石墨加热元件和氧化铝保护管组成来完美地调节样品和惰性参比材料的实验条件。

TGA, DTA, DSC配件:

- 从20 µl到1.5ml的陶瓷或金属坩埚
- TG悬浮体或传感器
- DTA和DSC 传感器分别达到1750°C和1600°C
- 独特的三对热电偶DTA传感器

配有高灵敏度热电偶的温度控制系统，以优化所有温区的精确控温要求。



THEMYS DUO模块剖面示意图